DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

015710639 **Image available** WPI Acc No: 2003-772839/200373

XRPX Acc No: N03-619312

Functional element substrate manufacturing apparatus e.g. for organic electroluminescence element substrate, injects droplet of functional element to horizontal substrate, in direction opposite to gravity direction

Patent Assignee: RICOH KK (RICO)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 2003264072 A 20030919 JP 200263185 A 20020308 200373 B

Priority Applications (No Type Date): JP 200263185 A 20020308

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 2003264072 A 11 H05B-033/10

Abstract (Basic): JP 2003264072 A

NOVELTY - The apparatus has an injection head (11) which injects droplet (43) of functional element such as organic electroluminescence element to functional element substrate (14) held horizontally by a substrate holding stand (13), in a direction opposite to gravity direction (G).

DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are also included for the following:

- (1) functional element substrate; and
- (2) image display device.

USE - For manufacturing functional element substrate (claimed) such as organic electroluminescence element substrate, used in image display device (claimed).

ADVANTAGE - The adherence of foreign materials such as dust in air to the functional element substrate is avoided, since the functional element is applied in a direction opposite to gravity. A high quality functional element substrate of simple structure is manufactured inexpensively with high accuracy. A high-resolution image display device is obtained due to the usage of high quality functional element substrate.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the block diagram explaining the relationship between functional element substrate and droplet injection direction.

injection head (11)

substrate holding stand (13)

functional element substrate (14)

functional element droplet (43)

gravity direction (G)

pp; 11 DwgNo 5/7

Title Terms: FUNCTION; ELEMENT; SUBSTRATE; MANUFACTURE; APPARATUS; ORGANIC; ELECTROLUMINESCENT; ELEMENT; SUBSTRATE; INJECTION; DROP;

FUNCTION; ELEMENT; HORIZONTAL; SUBSTRATE; DIRECTION; OPPOSED;

GRAVITY; DIRECTION

Derwent Class: P75; U11; U14

International Patent Class (Main): H05B-033/10

International Patent Class (Additional): B41J-002/01; H05B-033/14

File Segment: EPI; EngPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

07770162 **Image available**

FUNCTIONAL ELEMENT SUBSTRATE, IMAGE DISPLAY DEVICE, AND

MANUFACTURING INSTALLATION OF THE SAME

PUB. NO.: 2003

2003-264072 [JP 2003264072 A]

PUBLISHED:

September 19, 2003 (20030919)

INVENTOR(s): SEKIYA TAKURO APPLICANT(s): RICOH CO LTD

APPL. NO.:

2002-063185 [JP 200263185]

FILED:

March 08, 2002 (20020308)

INTL CLASS:

H05B-033/10; B41J-002/01; H05B-033/14

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture a quality functional element substrate with a simple composition in which foreign matters, such as an impurity which floats in the air, do not fall on a functional element formation section.

SOLUTION: With respect to the position relation between an injection head 11 and the functional element substrate 14 at the time of injecting the droplets 43 of a solution containing a functional material to adhere to the functional element board 14 from the injection head 11, the direction of injection is made in an opposite direction to the gravitational attraction direction G (it is injected upward) and further, at the time of adhering, is made to adhere in an almost perpendicular direction to the face of the substrate 14. That is, by arranging the functional element board 14 almost horizontally, and by injecting the droplets 43 of a solution to adhere from the underside, the fall of performance of the functional element caused by adhering of foreign matters, such as dust which floats in the air, fallen on the functional element formation section of the functional element board 14, is avoided.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2003—264072

(P2003-264072A) (43)公開日 平成15年9月19日(2003.9.19)

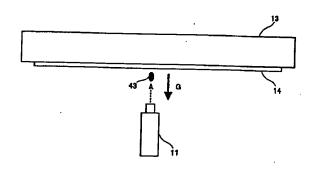
(51) Int. C1. 7 H05B 33/10 B41J 2/01 H05B 33/14	識別記号	F I デーマコード (参考) H05B 33/10 2C056 33/14 A 3K007 B41J 3/04 101 Z
		審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全11頁)
(21)出願番号	特願2002-63185(P2002-63185)	(71)出願人 000006747
(22) 出願日	平成14年3月8日(2002.3.8)	株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 (72)発明者 関谷 卓朗 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内 (74)代理人 100079843 弁理士 高野 明近 (外1名) Fターム(参考) 2C056 EB27 EC11 EC35 FA02 FA15 FB01 HA58 3K007 AB18 DB03 FA01

(54) 【発明の名称】機能性素子基板、画像表示装置およびその製造装置

(57)【要約】

【課題】 機能性素子群形成部に空中に浮遊する不純物 等の異物が落ちてくることがなく、簡単な構成で高品質 な機能性素子基板を製作できるようにした。

【解決手段】 噴射ヘッド11と機能性素子基板14の位置関係を、噴射ヘッド11から機能性材料を含有する溶液の液滴43が機能性素子基板14へ噴射、付与される時に、重力作用方向Gに対して反対方向にする(上方向に噴射する)とともに、付与時に基板14の面にほぼ垂直の方向から付与する。つまり、機能性素子基板14をほぼ水平に配置させ、下側から、溶液の液滴43の噴射、付与を行うようにして、空気中に浮遊する塵埃等の異物が、機能性素子基板14の機能性素子形成部に落下してきて付着し、形成される機能性素子の性能低下を引き起こすことを回避している。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の駆動信号を入力することにより機 能を発する機能性素子群が、基板上に機能性材料を含有 する溶液の液滴を噴射付与し、該溶液中の揮発成分を揮 発させ、固形分を前記基板上に残留させることによって 形成される機能性素子基板の製造装置であって、前記基 板に相対する位置に配され、該基板に対して機能性材料 を含有した溶液を噴射する噴射ヘッドと、該噴射ヘッド に液滴付与情報を入力する情報入力手段とを有し、前記 ドの溶液噴射口面とが一定の距離を保持し、前記基板と 前記噴射ヘッドとが前記機能性素子群の形成面に対して 平行に相対移動を行うように構成され、前記噴射ヘッド は、前記情報入力手段により入力された前記液滴付与情 報に基づいて前記基板の所望の位置に前記溶液を噴射す ることにより前記機能性案子群を形成する製造装置にお いて、前記噴射ヘッドと前記基板の位置関係を、前記噴 射ヘッドから前記溶液が、ほぼ水平から垂直の範囲に上 方に向けて噴射、付与されるとともに、前記溶液の付与 時に前記基板面にほぼ垂直方向から付与するようにした 20 ことを特徴とする機能性素子基板の製造装置。

1

【請求項2】 前記基板は前記溶液の付与面がほぼ下向 きに配置されるとともに、前記基板配置領域に重力作用 方向のベクトル成分を含む気体流を形成したことを特徴 とする請求項1記載の機能性案子基板の製造装置。

【請求項3】 前記噴射ヘッドから前記溶液を噴射、付 与する時の速度を前記気体流の速度より大としたことを 特徴とする請求項2記載の機能性素子基板の製造装置。

【請求項4】 請求項1乃至請求項3の機能性素子基板 の製造装置によって形成されることを特徴とする機能性 30 素子基板。

【請求項5】 請求項4の機能性素子基板と、この機能 性素子基板に対向して配置されたカパープレートとを有 することを特徴とする画像表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、吐出装置を用いた 機能性材料の膜形成、特に膜パターン形成製造装置およ びそれによって形成された機能性素子基板ならびにその 機能性素子基板を用いた画像表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、液晶ディスプレイに替わる自発光 型ディスプレイとして有機物を用いた発光索子の開発が 加速している。このような案子形成は、機能材料のパタ ーン化により行われ、一般的には、フォトリソグラフィ 一法により行われている。例えば、有機物を用いた有機 エレクトロルミネッセンス (以下有機ELと記す) 案子 としては、Appl. Phys. Lett. 51 (1 2)、21September1987の913ページ から示されているように低分子を蒸着法で成膜する方法 50 成分を揮発させ、固形分を前記基板上に残留させること

が報告されている。また、有機EL案子において、カラ 一化の手段としては、マスク越しに異なる発光材料を所 望の画素上に蒸着し形成する方法が行われている。しか しながら、このような真空成膜による方法、フォトリソ グラフィー法による方法は、大面積にわたって素子を形 成するには、工程数も多く、生産コストが高いといった 欠点がある。

【0003】上述のような課題に対して、本発明者は、 上述のごとき有機EL索子に代表されるような機能性素 基板における前記機能性素子群の形成面と前記噴射ヘッ 10 子形成のための、機能性材料膜の形成およびパターン化 にあたり、米国特許第3060429号、米国特許第3 298030号、米国特許第3596275号、米国特 許第3416153号、米国特許第3747120号、 米国特許第5729257号等として知られるようなイ ンクジェット液滴付与手段によって、真空成膜法とフォ トリソグラフィー・エッチング法等によらずに、安定的 に歩留まり良くかつ低コストで機能性材料を所望の位置 に付与することができるのではないかと考えた。

> 【0004】例えば、機能性索子の一例として有機EL 素子を考えた場合、このような有機EL素子を構成する 正孔注入/輸送材料ならびに発光材料を溶媒に溶解また は分散させた組成物を、インクジェットヘッドから吐出 させて透明電極基板上にパターニング塗布し、正孔注入 /輸送層ならびに発光材層をパターン形成すれば実現で きると考えたのである。しかしながら、このような機能 性素子を形成する場合は、その機能性素子形成面には大 変な清浄度が要求され、いわゆるインクを紙に向けて飛 翔、付着、吸収させて記録を行うインクジェット記録の 場合のように、紙粉が浮遊しているような場合とは根本 的に考え方を変える必要がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述のごと き実情に鑑みてなされたもので、その第1の目的は、こ のような機能性素子群および機能性素子基板を形成する ための新規な製造装置を提案することにある。また第2 の目的は、高品質な機能性素子群を形成するための製造 装置を提案することにある。さらに第3の目的は、髙精 度にこのような機能性素子群を形成するための製造装置 を提案することにある。また第4の目的は、このような 40 製造装置によって製作され、機能性素子群が高品質かつ 高精度な位置で形成された機能性素子基板を提案するこ とにある。さらに第5の目的は、このような製造装置に よって製作された高品質かつ高精度な機能性素子基板を 用いた画像表示装置を提案することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、前記目的を達 成するために、第1に、所定の駆動信号を入力すること により機能を発する機能性案子群が、基板上に機能性材 料を含有する溶液の液滴を噴射付与し、該溶液中の揮発

によって形成される機能性素子基板の製造装置におい て、前記基板に相対する位置に配され、該基板に対して 機能性材料を含有した溶液を噴射する噴射ヘッドと、該 噴射ヘッドに液滴付与情報を入力する情報入力手段とを 有し、前記基板における前記機能性素子群の形成面と前 記噴射ヘッドの溶液噴射口面とが一定の距離を保持し、

前記基板と前記噴射ヘッドとが前記機能性素子群の形成 面に対して平行に相対移動を行うように構成され、前記 噴射ヘッドは、前記情報入力手段により入力された前記 液滴付与情報に基づいて前記基板の所望の位置に前記溶 10 液を噴射することにより前記機能性素子群を形成する製 造装置であって、前記噴射ヘッドと前記基板の位置関係 を、前記噴射ヘッドから前記溶液が、ほぼ水平から垂直 の範囲に上方に向けて、噴射、付与されるとともに、前 記溶液の付与時に前記基板面にほぼ垂直方向から付与す るようにした。

【0007】第2に、上記第1の機能性素子基板の製造 装置において、前記基板は前記溶液の付与面がほぼ下向 きに配置されるとともに、前記基板配置領域に重力作用 方向のベクトル成分を含む気体流を形成するようにし た。

【0008】第3に、上記第2の機能性素子基板の製造 装置において、前記噴射ヘッドから前記溶液を噴射、付 与する時の速度を前記気体流の速度より大とするように した。

【0009】第4に、上記第1乃至第3のいずれかの機 能性素子基板の製造装置によって機能性素子基板を形成 するようにした。

【0010】第5に、上記第4の機能性素子基板と、こ の機能性素子基板に対向して配置されたカバープレート 30 する。 とを有するような画像表示装置とした。

[0011]

【発明の実施の形態】図1は、機能性素子の一例として 有機EL素子を考えた場合である。ここでは、モザイク 状に区切られた I TO (インジウムチンオキサイド) 透 明電極パターン4、および透明電極部分を囲む障壁3付 きガラス基板5の当該電極上に、赤、緑、青に発色する 有機EL材料を溶解した溶液2を各色モザイク状に配列 するように、ノズル1より付与する例を示している。溶 液の組成は、例えば、以下のとおりである。

溶液組成物

溶媒・・・・ドデシルベンゼン/ジクロロベンゼン (1

赤・・・・・ポリフルオレン/ペリレン染料(98/ 2, 重量比)

緑・・・・・ポリフルオレン/クマリン染料 (98. 5/1.5, 重量比)

青・・・・・ポリフルオレン

【0012】固形物の溶媒に対する割合は、例えば、

溶液を付与された基板は、例えば、100℃で加熱し、 溶媒を除去してからこの基板上に適当な金属マスクをし アルミニウムを2000オングストローム蒸着し(不図 示)、ITOとアルミニウムよりリード線を引き出し、 IT〇を陽極、アルミニウムを陰極として素子が完成す る。印加電圧は15ポルト程度で所定の形状で赤、緑、 青色に発光する素子が得られる。なお、先に基板上に電 極を形成しておいて、後からこのような溶液の液滴を噴 射付与し、溶液中の揮発成分を揮発させ、固形分を前記 基板上に残留させることによって素子形成を行ってもよ

【0013】そして、このような素子を構成した基板 は、ガラスあるいはプラスチック等の透明カバープレー トを対向配置、ケーシング(パッケージング)すること により、自発光型の有機ELディスプレイ等の画像表示 装置とすることができる。なお、ここでは機能性素子の 一例として有機EL素子を考えた場合であるが、必ずし もこのような素子、材料に限定されるものではない。例 えば、電子放出素子を考えた場合、パラジウム系の化合 20 物を含有する溶液が使用される。この場合は、最終形態 としては、この電子放出素子基板に蛍光体を具備したフ エースプレートを対向配置してパッケージングされた電 子放出型ディスプレイとなる。また、機能性素子として 有機トランジスタなども好適に製作できる。また、上記 例の障壁3を形成するためのレジスト材料なども本発明 に使用する溶液として利用される。

【0014】ここで、このような機能性材料を含有した 溶液を付与する手段として、本発明では、インクジェッ トの技術が適用される。以下に、その具体的方法を説明

【0015】図2は、本発明の機能性素子基板の製造装 置の一実施例を説明するための図で、図中、11は吐出 ヘッドユニット(噴射ヘッド)、12はキャリッジ、1 3は基板保持台、14は機能性素子を形成する基板、1 5機能性材料を含有する溶液の供給チューブ、16は信 **号供給ケーブル、17は噴射ヘッドコントロールボック** ス、18はキャリッジ12のX方向スキャンモータ、1 9はキャリッジ12のY方向スキャンモータ、20はコ ンピュータ、21はコントロールボックス、22(22 40 X,,22Y,,22X2,22Y2) は基板位置決め/ 保持手段である。

【0016】図3は、本発明の機能性素子基板の製造に 適用される液滴付与装置の構成を示す概略図で、図4 は、図3の液滴付与装置の吐出ヘッドユニットの要部概 略構成図である。図3の構成は、図2の構成と異なり、 基板14側を移動させて機能性素子群を基板に形成する ものである。図3及び図4において、31はヘッドアラ イメント制御機構、32は検出光学系、33はインクジ エットヘッド、34はヘッドアライメント微動機構、3 0.4% (重量/体積) とされる。ここで、このような 50 5 は制御コンピュータ、3 6 は画像識別機構、3 7 は X

Y方向走査機構、38は位置検出機構、39は位置補正 制御機構、40はインクジェットヘッド駆動・制御機 構、41は光軸、42は素子電極、43は液滴、44は 液滴着弾位置である。

【0017】吐出ヘッドユニット11の液滴付与装置 (インクジェットヘッド33) としては、任意の液滴を 定量吐出できるものであればいかなる機構でも良く、特 に数~数100p!程度の液滴を形成できるインクジェ ット方式の機構が望ましい。インクジェット方式として されている方式(201tan方式)、米国特許第37 47120号明細魯に開示されている方式 (Stemm e 方式) 、米国特許第3946398号明細書に開示さ れている方式 (Kyser方式) のようにピエゾ振動素 子に、電気的信号を印加し、この電気的信号をピエゾ振 動素子の機械的振動に変え、該機械的振動に従って微細 なノズルから液滴を吐出飛翔させるものがあり、通常、 総称してドロップオンデマンド方式と呼ばれている。

【0018】他の方式として、米国特許第359627 示されている方式 (Sweet方式) がある。これは連 統振動発生法によって帯電量の制御された記録液体の小 滴を発生させ、この発生された帯電量の制御された小滴 を、一様の電界が掛けられている偏向電極間を飛翔させ ることで、記録部材上に記録を行うものであり、通常、 連続流方式、あるいは荷電制御方式と呼ばれている。

【0019】さらに、他の方式として、特公昭56-9 429号公報に開示されている方式がある。これは液体 中で気泡を発生せしめ、その気泡の作用力により微細な ノズルから液滴を吐出飛翔させるものであり、サーマル 30 インクジェット方式、あるいはパプルインクジェット方 式と呼ばれている。このように液滴を噴射する方式は、 ドロップオンデマンド方式、連続流方式、サーマルイン クジェット方式等あるが、必要に応じて適宜その方式を 選べばよい。

【0020】本発明では、図2に示したような機能性素 子基板の製造装置において、基板14は、この装置の基 板位置決め/保持手段22によってその保持位置を調整 して決められる。図2では簡略化しているが、基板位置 決め/保持手段22は基板14の各辺に当接されるとと 40 もに、X方向およびそれに直交するY方向にμmオーダ ーで微調整できるようになっているとともに、噴射ヘッ ドコントロールボックス17、コンピュータ20、コン トロールポックス21等と接続され、その位置決め情報 および微調整変位情報等と、液滴付与の位置情報、タイ ミング等は、たえずフィードバックできるようになって いる。さらに、本発明の機能性素子基板の製造装置で は、X、Y方向の位置調整機構の他に図示しない(基板 14の下に位置するために見えない)、回転位置調整機 構を有している。

【0021】これに関連して、先に、本発明の機能性素 子基板の形状および形成される機能性素子群の配列に関 して説明する。本発明の機能性素子基板は、石英ガラ ス、Na等の不純物含有量を低減させたガラス、背板ガ ラス、SiO,を表面に堆積させたガラス基板およびア ルミナ等のセラミックス基板等が用いられる。また、軽 **量化あるいは可撓性を目的として、PETを始めとする** 各種プラスチック基板も好適に用いられる。いずれにし ろその形状はこのような基板を経済的に生産、供給す は、たとえば米国特許第3683212号明細書に開示 10 る、あるいは最終的に製作される機能性案子基板の用途 から、Siウエハなどとは違って、矩形(直角4辺形) である。つまり、その矩形形状を構成する縦2辺、横2 辺はそれぞれ、縦2辺が互いに平行、横2辺が互いに平 行であり、かつ縦横の辺は直角をなすような基板であ る。

【0022】上述のような基板に対して、本発明では、 形成される機能性素子群をマトリックス状に配列し、こ のマトリックスの互いに直交する2方向が、この基板の 縦方向の辺あるいは横方向の辺の方向と平行であるよう 5号明細書、米国特許第3298030号明細書等に開 20 に機能性素子群を配列する。このように機能性素子群を マトリックス状に配列する理由および、基板の縦横の辺 をそのマトリックスの直交する2方向と平行になるよう にする理由を以下に述べる。

> 【0023】図2あるいは図3に示したように、本発明 では、最初に、基板14と吐出ヘッドユニット11の溶 液噴射口面の位置関係が決められた後は、特に位置制御 を行うことはない。つまり、吐出ヘッドユニット11は 基板14に対して一定の距離を保ちながら機能性素子群 の形成面に対して平行にX、Y方向の相対移動を行いつ つ、上記溶液(たとえば有機EL材料、あるいは導電性 材料を溶解した溶液、レジスト材料など)の噴射を行 う。つまり、このX方向及びY方向は互いに直交する2 方向であり、基板の位置決めを行う際に、基板の縦辺あ るいは横辺をそのY方向あるいはX方向と平行になるよ うにしておけば、形成される機能性素子群もそのマトリ ックス状配列の2方向がそれぞれ平行であるため、相対 移動を行いつつ噴射する機構のみで高精度の案子群形成 を行うことができる。言い換えるならば、本発明のよう な基板形状、機能性素子群のマトリックス状配列、直交 するX、Yの2方向の相対移動装置にすれば、素子形成 の液滴噴射を行う前の基板の位置決めを正確に行えば、 高精度な機能性素子群のマトリックス状配列が得られる ということである。

【0024】ここで、先ほどの回転位置調整機構に戻っ て説明する。前述のように、本発明では、案子形成の液 滴噴射を行う前の基板の位置決めを正確に行い、Xおよ びY方向の相対移動のみを行い、他の制御を行わず、高 精度な機能性素子群のマトリックス状配列を得ようとい うものである。その際、問題となるのは、最初に基板の 50 位置決めを行う際の回転方向(X、Yの2方向で決定さ

れる平面に対して垂直方向の軸に対する回転方向) のズ レである。この回転方向のズレを補正するために、本発 明では、前述のように図示しない(基板14の下に位置 して見えない)、回転位置調整機構を有している。これ により回転方向のズレも補正し、基板の辺を位置決めす ると、本発明の装置では、XおよびY方向のみの相対移 動で、高精度な機能性素子群のマトリックス状配列が得 られる。

【0025】以上は、回転位置調整機構を、図2の基板 位置決め/保持手段22(22X1, 22Y1, 22 X_2 , 22 Y_2) とは別物の機構として説明した (基板 14の下に位置して見えない)が、基板位置決め/保持 手段22に回転位置調整機構を持たせることも可能であ る。例えば、基板位置決め/保持手段22は、基板14 の辺に当接され、基板位置決め/保持手段22全体が、 X方向あるいはY方向に位置を調整できるようになって いるが、基板位置決め/保持手段22の基板14の辺に 当接される部分において、距離をおいて設けられた2本 のネジが独立に動くようにしておけば、角度調整が可能 である。なお、この回転位置制御情報も上記のX、Y方 20 向の位置決め情報および微調整変位情報等と同様に噴射 ヘッドコントロールボックス17、コンピュータ20、 コントロールボックス21等と接続され、液滴付与の位 置情報、タイミング等が、たえずフィードバックできる ようになっている。

【0026】次に、本発明の位置決めの他の手段、構成 について説明する。上記の説明において、基板位置決め /保持手段22は、基板14の辺に当接され、基板位置 決め/保持手段22全体が、X方向あるいはY方向に位 置を調整できるようにしたものであるが、ここでは、基 30 板14の辺ではなく、基板上に互いに直交する2方向に 帯状パターンを設けるようにした例について説明する。 前述のように、本発明では基板上に機能性素子群をマト リックス状に配列して形成されるが、ここでは、前記の ような互いに直交する2方向の帯状パターンをこのマト リックスの互いに直交する2方向と平行になるように形 成しておく。このようなパターンは、基板上にフォトフ ァブリケーション技術によって容易に形成できる。ある いは、上述のようなパターンをその目的のためだけに作 成するのではなく、素子電極 $4\,2$ (図 $4\,$ 参照)や、各素 $40\,$ ト $1\,1\,$ が位置している。本実施例では、吐出ヘッドユニ 子のX方向配線やY方向配線等の配線パターンを本発明 の互いに直交する2方向の帯状パターンとみなしてもよ い。このような帯状パターンを設けておけば、図4で後 述するような、CCDカメラとレンズとを用いた検出光 学系32によってパターン検出ができ、位置調整にフィ ードバックできる。

【0027】次に、上記X、Y方向に対して垂直方向で ある 2 方向であるが、本発明では、最初に基板 1 4 と吐 出ヘッドユニット11の溶液噴射口面の位置関係が決め られた後は、特に位置制御を行うことはない。つまり、

吐出ヘッドユニット11は基板14に対して一定の距離 を保ちながらX、Y方向の相対移動を行いつつ、機能性 材料を含有する溶液の噴射を行うが、その噴射時には、 吐出ヘッドユニット11のZ方向の位置制御は特に行わ ない。その理由は、噴射時にその制御を行うと、機構、 制御システム等が複雑になるだけではなく、基板14へ の液滴付与による機能性素子の形成が遅くなり、生産性 が著しく低下するからである。

【0028】かわりに、本発明では基板14の平面度や 10 その基板14を保持する部分の装置の平面度、さらに吐 出ヘッドユニット11をX、Y方向に相対移動を行わせ るキャリッジ機構等の精度を髙めるようにすることで、 噴射時の2方向制御を行わず、吐出ヘッドユニット11 と基板14のX、Y方向の相対移動を高速で行い、生産 性を高めている。一例をあげると、本発明の溶液付与時 (噴射時) における基板14と吐出ヘッドユニット11 の溶液噴射口面の距離の変動は5mm以下におさえられ ている(基板14のサイズが200mm×200mm以 上、4000mm×4000mm以下の場合)。

【0029】なお、通常X、Y方向の2方向で決まる平 面は水平(鉛直方向に対して垂直な面)に維持されるよ うに装置構成されるが、基板14が小さい場合(例えば 500mm×500mm以下の場合) には必ずしもX、 Y方向の2方向で決まる平面を水平にする必要はなく、 その装置にとってもっとも効率的な基板14の配置の位 置関係になるようにすればよい。

【0030】次に、本発明の他の実施例を説明するが、 本発明はこれらの例に限定されるものではない。図3 は、図2の場合と違い、吐出ヘッドユニット11と基板 (機能性素子基板) 14の相対移動を行う際に、機能性 素子基板14側を移動させる例である。図4は、図3の 装置の吐出ヘッドユニットを拡大して示した概略構成図 である。まず、図3において、37はXY方向走査機構 であり、その上に機能性素子基板14が載置してある。 基板14上の機能性素子は、例えば、図1のものと同じ 構成であり、単素子としては図1に示した構成と同様 に、ガラス基板5 (機能性素子基板14に相当する)、 障壁3、IT〇透明電極4よりなっている。この機能性 素子基板14の上方に液滴を付与する吐出ヘッドユニッ ット11は固定で、機能性素子基板14がXY方向走査 機構37により任意の位置に移動することで吐出ヘッド ユニット11と機能性素子基板14との相対移動が実現

【0031】次に、図4により吐出ヘッドユニット11 の構成を説明する。図4において、32は基板14上の 画像情報を取り込む検出光学系であり、液滴43を吐出 させるインクジェットヘッド33に近接し、検出光学系 32の光軸41および焦点位置と、インクジェットヘッ 50 ド33による液滴43の着弾位置44とが一致するよう

配置されている。この場合、図3に示す検出光学系32 とインクジェットヘッド33との位置関係はヘッドアラ イメント微動機構34とヘッドアライメント制御機構3 1により精密に調整できるようになっている。また、検 出光学系32には、CCDカメラとレンズとを用いてい

【0032】図3において、36は検出光学系32で取 り込まれた画像情報を識別する画像識別機構であり、画 像のコントラストを2値化し、2値化した特定コントラ スト部分の重心位置を算出する機能を有したものであ る。具体的には(株)キーエンス製の高精度画像認識装 置、VX-4210を用いることができる。これによっ て得られた画像情報に機能性素子基板14上における位 置情報を与える手段が位置検出機構38である。これに は、XY方向走査機構37に設けられたリニアエンコー ダ等の測長器を利用することができる。また、これらの 画像情報と機能性素子基板14上での位置情報をもと に、位置補正を行うのが位置補正制御機構39であり、 この機構により X Y 方向走査機構 3 7 の動きに補正が加 えられる。また、インクジェットヘッド駆動・制御機構 20 与をこのような直交する2方向に順次行うようにする構 40によってインクジェットヘッド33が駆動され、液 滴が機能性素子基板14上に付与される。これまで述べ た各制御機構は、制御用コンピュータ35により集中制 御される。

【0033】なお、以上の説明では、吐出ヘッドユニッ ト11は固定で、機能性素子基板14がXY方向走査機 構37により任意の位置に移動することで吐出ヘッドユ ニット11と機能性索子基板14との相対移動を実現し ているが、図2に示したように、機能性素子基板14を 固定とし、吐出ヘッドユニット11がXY方向に走査す 30 ルレッド、クマリン6、キナクリドン、ポリチオフェン るような構成としてもよいことはいうまでもない。特に 200mm×200mm程度の中型基板~2000mm ×2000mmあるいはそれ以上の大型基板の製作に適 用する場合には、後者のように機能性素子基板14を固 定とし、吐出ヘッドユニット11が直交するX、Yの2 方向に走査するようにし、溶液の液滴の付与をこのよう な直交する2方向に順次行うようにする構成としたほう

【0034】また、逆に、例えば、軽いプラスチック基 板を使用し、そのサイズも200mm×200mm~4 40 00mm×400mm程度の中型基板の場合において は、インクジェットプリンタの紙搬送を行うようにする ことも考えられる。つまり、キャリッジ12に搭載され た吐出ヘッドユニット11が、X方向のみ(もしくはY 方向のみ)に走査され、基板がY方向(もしくはX方 向)に搬送される。その場合は生産性が著しく向上す る。

【0035】基板14のサイズが200mm×200m m程度以下の場合には、液滴付与のための吐出ヘッドユ ニットを200mmの範囲をカバーできるラージアレイ 50 ン, O-クロロトルエン, p-クロロトルエン, 1-ク

マルチノズルタイプとし、吐出ヘッドユニットと基板の 相対移動を直交する2方向(X方向、Y方向)に行うこ となく、1方向のみ(例えばX方向のみ)に相対移動さ せて行うことも可能であり、また量産性も高くすること ができるが、基板サイズが200mm×200mm以上 の場合には、そのような200mmの範囲をカパーでき るラージアレイマルチノズルタイプの吐出ヘッドユニッ トを製作することは技術的/コスト的に実現困難であ り、本発明のように吐出ヘッドユニット11が直交する 10 X、Yの2方向に走査するようにし、溶液の液滴の付与 をこのような直交する2方向に順次行うようにする構成 としたほうがよい。

【0036】特に、最終的な基板としては、200mm ×200mmより小さいものを製作する場合であって も、大きな基板から複数個取りして製作するような場合 には、その元の基板は、400mm×400mm~20 00mm×2000mmあるいはそれ以上のものを使用 することになるので、吐出ヘッドユニット11が直交す るX、Yの2方向に走査するようにし、溶液の液滴の付 成としたほうがよい。

【0037】液滴43の材料には、先に述べた有機EL 材料の他に、例えば、ポリフェニレンビニレン系(ポリ パラフェニリレンピニレン系誘導体)、ポリフェニレン 系誘導体、その他、ベンゼン誘導体に可溶な低分子系有 機EL材料、高分子系有機EL材料、ポリピニルカルバ ゾール等の材料を用いることができる。有機EL材料の 具体例としては、ルプレン、ペリレン、9、10-ジフ ェニルアントラセン、テトラフェニルプタジエン、ナイ 誘導体等が挙げられる。また、有機EL表示における周 辺材料である電子輸送性、ホール輸送性材料も本発明の 機能性素子を製作する機能材料として使用される。

【0038】本発明の他の機能性素子を製作する機能材 料としては、この他に半導体等に多用される層間絶縁膜 のシリコンガラスの前駆物質であるか、シリカガラス形 成材料を挙げることができる。かかる前駆物質として、 ポリシラザン(例えば東燃製)、有機SOG材料等が挙 げられる。また有機金属化合物を用いても良い。

【0039】更に、他の例として、カラーフィルター用 材料が挙げられる。具体的には、スミカレッドB(商品 名、住友化学製染料)、カヤロンフアストイエローGL (商品名、日本化薬製染料)、ダイアセリンフアストブ リリアンプルーB(商品名、三菱化成製染料)等の昇華 染料等を用いることができる。

【0040】本発明の溶液組成物において、ペンゼン誘 導体の沸点が150℃以上であることが好ましい。この ような溶媒の具体例としては、〇-ジクロロベンゼン、 m-ジクロロベンゼン、1、2、3-トリクロロベンゼ る。

ロロナフタレン, ブロモベンゼン, 〇-ジブロモベンゼ ン、1-ジプロモナフタレン等が挙げられる。これらの 溶媒を用いることにより、溶媒の揮散が防げるので好適 である。これらの溶媒は芳香族化合物に対する溶解度が 大きく好適である。また、本発明の溶液組成物ドデシル ベンゼンを含むことが好ましい。ドデシルベンゼンとし てはn-ドデシルベンゼン単一でも良く、また異性体の 混合物を用いることもできる。

11

【0041】この溶媒は沸点300℃以上、粘度6cp ん良いが、他の溶媒に加えることにより、溶媒の揮散を 効果的に防げ、好適である。また、上記溶媒のうちドデ シルベンゼン以外は粘度が比較的小さいため、この溶媒 を加えることにより粘度も調整できるため非常に好適で ある。本発明によれば、上述したような溶液組成物を吐 出装置により基板上に吐出により供給した後、基板を吐 出時温度より高温で処理して膜化する機能膜形成法が提 供される。吐出温度は室温であり、吐出後、基板を加熱 することが好ましい。このような処理をすることによ 容物が再溶解され、均一、均質な機能膜を得ることがで きる。上述の機能膜の作製法において、吐出組成物を吐 出装置により基板上に供給後、基板を吐出時温度より高 温に処理する際に、加圧しながら加熱することが好まし い。このように処理することにより、加熱時の溶媒の揮 散を遅らすことができ、内容物の再溶解が更に促進され る。その結果、均一、均質な機能膜を得ることができ る。また、上述の機能膜の作製法において、前記基板を 髙温処理後直ちに減圧し、溶媒を除去することが好まし い。このように処理することにより、溶媒の濃縮時の内 30 容物の相分離を防ぐことができる。

【0042】いずれの材料、あるいは機能性素子におい ても、本発明は、該溶液中の揮発成分を揮発させ、固形 分を前記基板上に残留させることによって素子形成を行 うものであり、この固形物がそれぞれの素子の機能を発 生させるものであり、溶媒(揮発成分)はインクジェッ ト原理で液滴を噴射付与するための手段(vehicl e) である。

【0043】上述の液滴43を吐出ヘッドユニット(噴 射ヘッド)11により所望の素子電極部に付与する際に 40 射、付与を行うようにしている。こうすることにより、 は、付与すべき位置を検出光学系32と画像識別機構3 6とで計測し、その計測データ、吐出ヘッドユニット (噴射ヘッド) 11の吐出口面と機能性素子基板14の 距離、キャリッジの移動速度に基づいて補正座標を生成 し、この補正座標通りに機能性素子基板14前面を吐出 ヘッドユニット(噴射ヘッド)11をX、Y方向に移動 せしめながら液滴を付与する。検出光学系32として は、CCDカメラ等とレンズを組み合わせたものを用 い、画像識別機構36としては、市販のもので画像を2 値化しその重心位置を求めるもの等を用いることができ 50

【0044】上述のように、本発明では、吐出ヘッドユ ニット(噴射ヘッド)11は機能性素子基板14に対し て一定の距離を保ちながら平行にX方向(あるいはY方 向、もしくはX、Yの2方向)にキャリッジ移動を行い つつ溶液の噴射を行い、機能性素子群を形成する。その 際、各素子を形成するための溶液の噴射を行う毎にキャ リッジ移動を止めて噴射を行うと高精度な素子群を形成 することが可能である。しかし、生産性が著しく低下す 以上(20℃)の特性を有し、この溶媒単一でももちろ 10 るので、前述のように、そのキャリッジ移動を止めるこ となく、順次溶液の噴射を行うようにしている。

【0045】次に、本発明の他の特徴について説明す る。本発明では前述のように、機能性素子部を形成する のに機能性材料を含有する溶液を液体噴射によって液滴 を空中飛翔させ、基板に付着させて形成する。この原理 そのものは、一見、通常のインクジェットプリンタに類 似しており、それをそのまま適用すれば何ら問題がない ように見える。しかしながら、紙にインクを噴射、記録 するインクジェットプリンタの使用環境は、紙から発生 り、吐出時、溶媒の揮散、温度の低下により析出した内 20 する紙粉、紙の表面にコートしてあるたとえば炭酸カル シウム等の微粉、さらには通常の空気中に浮遊する種々 の異物等がたえず舞っている環境であり、それらは重力 作用によって紙面上の被記録面に落ちてきて付着する。 このような異物等はmmオーダーあるいはそれ以上のも のでない限り、インクジェット記録としては、画質劣化 に影響を及ぼすものではなく、ほとんど無視できるもの である。

> 【0046】しかしながら、本発明のような機能性素子 を形成する場合には、その異物が形成される機能性素子 部にあると、素子性能が著しく低下、あるいは機能しな くなるといった不具合を生じる。この点がインクジェッ トプリンタと本発明の大きな違いである。本発明ではこ の点に鑑み、図5に示すように、噴射ヘッド11と機能 性素子基板14の位置関係を、噴射ヘッド11から機能 性材料を含有する溶液の液滴43が噴射、付与される時 に重力作用方向Gに対して反対方向にする(上方向に噴 射する)とともに、付与時に基板面にほぼ垂直方向から 付与するようにしている。つまり、機能性素子基板14 をほほ水平に配置させ、下側から、溶液の液滴43の噴 前述に空気中に浮遊する塵埃等の異物が、機能性素子基 板14の機能性素子形成部に落下してきて付着し、形成 される機能性素子の性能低下を引き起こすということを 回避している。

【0047】なお、図1~図4は、液滴噴射原理を説明 するための図として使用し、従来のインクジェットプリ ンタのように、下向きに噴射する図としたが、実際に は、本発明では、これらはすべて逆向きの構成(図5の ように上向きに噴射)であることを断っておく。また、 図5では、機能性素子基板14がほほ水平に配置され、

下側から上方に向けて垂直に液滴43の噴射、付与を行 うように示したが、機能性素子基板14が完全に水平に 配置される必要はない。要は、重力作用によって、浮遊 している異物等が、基板の機能性素子形成部に落ちてこ なければよいので、形成面が下方を向いていればよい。 例えば、図6のように、機能性素子基板14を傾斜させ た構成であっても、空気中に浮遊する塵埃等の異物が、 機能性素子基板の機能性素子形成部に落下してきて付着 するということはなく、このような構成も本発明の範疇 に入るものである。

【0048】次に、本発明のさらに他の特徴について説 明する。上記説明では、空気中に浮遊する塵埃等の異物 が、機能性素子基板の機能性素子形成部に落下してきて 付着しないように、素子形成面を下向きにしたものであ るが、ここでは、よりその効果をあげるために、積極的 にそのような空気中に浮遊する塵埃等の異物が付着しな いようにした。図7は、その1例を示す図で、ここで は、機能性素子基板14および噴射ヘッド11が配置さ れる領域の下部に空気吸引領域50を設け、機能性素子 基板14および噴射ヘッド11が配置される領域に重力 20 作用方向Gのペクトル成分を含む気体流Airが形成さ れるようにした。ここで、空気吸引領域50はたとえば ファン(不図示)を回すことによって形成でき、吸引孔 51から空気Airを引き、機能性素子基板14および 噴射ヘッド11が配置される領域に重力作用方向Gのベ クトル成分を含む気体流を形成することができる。な お、ここで形成される気体流の流速としては後述する が、 $0.3 \sim 2 \, \text{m/s}$ 程度とするのがよい。

【0049】また、他の例としては、フィルターによっ て清浄化された窒素ガスなどを、機能性素子基板14お 30 も、駆動波形を制御し、その直径の3倍以内の長さにし よび噴射ヘッド11が配置される領域に重力作用方向の ベクトル成分を含むように積極的に流すようにしてもよ い。いずれにしろ、このような気体流を積極的に発生さ せることにより、単に機能性素子基板の素子形成面を下 向きにしただけの場合よりも、空気中に浮遊する塵埃等 の異物の付着をより効果的に防ぐことが可能となり、よ り信頼性の高い機能性素子基板が製作できる。

【0050】なお、本発明において、上述のような気体 流は、本発明の液滴の噴射、付与を行う方向と反対方向 の速度ペクトル成分を持つので、液滴の噴射、付与を妨 40 げるようなことがあってはならない。本発明では、この 点に鑑み、このような気体流の流速と、液滴の噴射、付 与の速度との関係を調べてみた。以下に、その結果を示 す。この例は、図7のように、下からファンにより吸引 して、機能性素子基板14および噴射ヘッド11が配置

される領域に重力作用方向のベクトル成分を含む気体流 Airが形成されるようにし、ファンの回転数を変え て、形成される気体流の速度を変えるとともに、液滴の 噴射、付与の速度を変えて、機能性素子基板14上で良 好な液滴付着ができ、機能性素子として機能するかどう か調べたものである。

【0051】使用した基板は、ITO透明電極付きガラ ス基板に、O-ジクロロベンゼン/ドデシルベンゼンの 混合溶液にポリヘキシルオキシフェニレンピニレンを 10 0.1 重量パーセント混合した溶液をインクジェット原 理で噴射速度を変えて付与した。噴射ヘッドノズルと基 板間の距離は3mmとした。インクジェットヘッドは、 ピエゾ索子を利用したドロップオンデマンド型インクジ エットヘッドで、ノズル径はΦ23μmで、噴射速度を 変えるためにピエゾ索子への入力電圧を18Vから30 Vまで変化させ、駆動周波数は、9.6 k H z とした。 なお、このようなピエゾ索子を利用したドロップオンデ マンド型インクジェットヘッドでは、ピエゾ案子への入 力電圧を変えて噴射速度を変えることができるが、その 時同時に、噴射滴の質量も変化するので、駆動波形(引 き打ちも含めた立ち上がり波形ならびに立下がり波形) を制御して、噴射滴の質量がいつもほぼ一定 (5 p l に した) になるようにし、噴射速度のみを変えるようにし

【0052】また、滴飛翔時の滴の形状を、素子形成と 同じ条件で別途噴射、観察し、その形状が、基板面に付 着する直前(今本発明例では3mm)にほぼ丸い滴にな るように駆動波形を制御して噴射させた。なお、完全に 丸い球状が得られず、飛翔方向に伸びた柱状であって た。また、その際、飛翔滴後方に複数の微小な滴を伴う ことのない駆動条件(駆動波形)を選んだ。その後、こ の上にアルミニウムを蒸着し、索子形成を行った。IT Oとアルミニウムよりリード線を引き出し、ITOを陽 極、アルミニウムを陰極として10Vの電圧を印加した ところ、表1のような結果が得られた。

【0053】ここで、基板上の素子形成状況が、○は狙 いの領域(電極部)に滴付与が行われたものであり、△ は部分的にそこから位置がずれたもの、×はそこから位 置がずれたものである。素子性能が○は所定の形状で橙 色に発光したものであり、×は発光しなかったり部分的 に発光 (案子としては実使用不可) したりしたものであ る。

[0054]

【表1】

実験	気体流速度	液滴噴射速度	基板上の素子形成状況	素子性能
No.	Vf(m/s)	Vj(m/s)		
1	0.3	3	0	0
2	0.3	5	0	0
3	0.3	7	0	0
4	0.3	1 2	0	0
5	0.8	3	0	0
6	0.8	5	0	0
7	0.8	7	0	0
8	0.8	1 2	0	0
9	2	3	Δ	×
10	2	5	0	0
11	2	7	0	0
12	2	1 2	0	0
13	5	3	×	×
14	5	5	×	×
15	5	7	Δ	×
16	5	1 2	0	0

[0055]以上の結果より、液滴噴射速度は、気体流速度より大にしないと良好な素子形成が行えないことが 20 わかった。また、その差も、 $1\sim2\,\mathrm{m/s}$ ではだめ(実験No.9、15)で、 $3\,\mathrm{m/s}$ 以上にすると良好な素子形成が行えることがわかった。さらに、気体流速度を大きくしすぎる(実験 $No.13\sim16$)と液滴噴射速度もそれに応じて速くしなければならず、液滴噴射速度の選択幅が狭くなるので、気体流速度は $0.3\sim2\,\mathrm{m/s}$ 程度にしておくのがよいこともわかった。

【0056】なお、図1で障壁3の中に液滴を噴射付与する例を示しているが、上記実験で機能性素子群を形成するに当たっては、図1に示したような障壁3はなく、平板上の基板に直接電極パターン形成や、液滴付与による機能性素子を形成していることをことわっておく。また、図4で液滴が基板面に斜めに噴射する図を示したが、これは検出光学系32と、インクジェットヘッド33を併せて図示するためにこのように液滴が斜めに飛翔している図としたが、実際には基板に対してほぼ垂直に当たるように噴射付与することもことわっておく。

【0057】また、説明は機能性素子として発光素子を形成した場合で行っているが、形成された発光素子基板は、その後、ガラスあるいはプラスチック等の透明カバ 40ープレートを対向配置、ケーシング (バッケージング)することにより、ディスプレイ装置として活用される。また、単にディスプレイ装置に適用するのみならず、機能性素子として有機トランジスタなども本発明の手法を利用して好適に製作される。また、噴射溶液としてレジスト材料などを用いることによって、レジストパターンやレジスト材料による3次元構造体を形成する場合にも適用され、本発明でいうところの機能性素子とは、このようなレジスト材料のような樹脂材料のよって形成される膜パターンあるいは3次元構造体も含むものである。50

[0058]

【発明の効果】請求項1に対応した効果

所定の駆動信号を入力することにより機能を発する機能 性素子群が、基板上に機能性材料を含有する溶液の液滴 を噴射付与し、該溶液中の揮発成分を揮発させ、固形分 を前記基板上に残留させることによって形成される機能 性素子基板の製造装置において、前記基板に相対する位 置に配され、該基板に対して機能性材料を含有した溶液 を噴射する噴射ヘッドと、該噴射ヘッドに液滴付与情報 を入力する情報入力手段とを有し、前記基板における前 記機能性素子群の形成面と前記噴射ヘッドの溶液噴射口 面とが一定の距離を保持し、前記基板と前記噴射ヘッド 30 とが前記機能性素子群の形成面に対して平行に相対移動 を行うように構成され、前記噴射ヘッドは、前記情報入 力手段により入力された前記液滴付与情報に基づいて前 記基板の所望の位置に前記溶液を噴射することにより前 記機能性素子群を形成する製造装置であって、前記噴射 ヘッドと前記基板の位置関係を、前記噴射ヘッドから前 記溶液が、ほぼ水平から垂直の範囲に上方に向けて、噴 射、付与されるとともに、前記溶液の付与時に前記基板 面にほぼ垂直方向から付与するようにしたので、機能性 素子群形成部に空中に浮遊する不純物等の異物が落ちて くることがなく、簡単な構成で高品質な機能性素子基板 を製作できるようになった。

【0059】請求項2に対応した効果

機能性素子基板の製造装置において、前記基板は前記溶液の付与面がほぼ下向きに配置されるとともに、前記基板配置領域に重力作用方向のベクトル成分を含む気体流を形成したので、空中に浮遊する不純物等の異物を機能性素子群形成部から積極的に排除でき、簡単な構成でより高品質な機能性素子群を形成することができるように50 なった。

18

【0060】 請求項3に対応した効果

機能性素子基板の製造装置において、前記噴射ヘッドか ら前記溶液を噴射、付与する時の速度を前記気体流の速 度より大としたので、簡単な構成でありながら、溶液噴 射が安定し、その液滴の着弾位置精度が高く、高精度に このような機能性素子群を形成することができるように なった。

17

【0061】請求項4に対応した効果

本発明による製造装置によって製作される機能性素子群 を形成された機能性素子基板であるので、大型の基板で 10 【符号の説明】 あっても歩留まりが高く低コストで、かつ高精度の機能 性素子群を形成した機能性素子基板が実現できるように なった。

【0062】 請求項5に対応した効果

高品質かつ高精度に形成された機能性素子基板を画像表 示装置に使用するようにしたので、高画質の画像表示装 置が得られるようになった。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施例にかかる吐出組成物を用い機 能性素子を作製する一工程を模式的に示す斜視図であ

【図2】 本発明の機能性素子基板の製造装置の一実施 例を説明するための図である。

【図3】 本発明の機能性素子基板の製造に適用される 液滴付与装置を示す概略構成図である。

【図4】 図3の液滴付与装置の叶出ヘッドユニットの

要部概略構成図である。

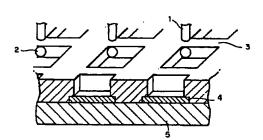
【図5】 本発明の機能性素子基板の製造装置における 機能性素子基板と液滴噴射方向の関係を示す概略構成図 である。

【図6】 本発明の機能性素子基板の製造装置における 機能性素子基板と液滴噴射方向の関係を示す他の概略構 成図である。

【図7】 本発明の機能性素子基板の製造装置において 気体流を形成する場合の概略構成図である。

1…(液体噴射ヘッド)ノズル、2…叶出される有機E L材料、3…有機物(ポリイミド) 障壁、4…ITO誘 明電極、5…ガラス基板、11…吐出ヘッドユニット (噴射ヘッド)、12…キャリッジ、13…基板保持 台、14…基板、15…機能性材料を含有する溶液の供 給チュープ、16…信号供給ケーブル、17、21…コ ントロールボックス、18…X方向スキャンモータ、1 9…Y方向スキャンモータ、20…コンピュータ、22 …基板位置決め/保持手段、31…ヘッドアライメント 20 制御機構、32…検出光学系、33…インクジェットへ ッド、34…ヘッドアライメント微動機構、35…制御 コンピュータ、36…画像識別機構、37…XY方向走 查機構、38…位置検出機構、39…位置補正制御機 構、40…インクジェットヘッド駆動・制御機構、41 …光軸、42…素子電極、43…液滴、44…液滴着彈 位置、50…エアー吸引領域、51エアー吸引孔。

【図1】



[図2]

